

2 主要装置一覧

ドラフト(酸・有機) ~6" フッ酸/硝酸/硫酸/塩酸等 有機洗浄/レジスト剥離等	真空オーブン ~6" ヤマト科学 DP-31	ブラシスクラバ ~6" 全協化成 研磨後のウェハ洗浄用	スピンド乾燥機 4", 6" SEMITOOL PSC101等3台 カセット式	LP-CVD ~6" システムサービス SiN, Poly-Si, NSG	熱CVD ~6" 国特電気 Epi-Poly Poly-Si, 1100°C	PE-CVD ~6" 日本生産技術 VDS-5600 SiN, SiO ₂	PE-CVD ~8" 住友精密 MPX-CVD SiN(応力制御可), SiO ₂
スピンド乾燥機 ~6" 東邦化成 ZAA-4 2台 平置き式	イナートオーブン ~6" ヤマト科学 DN63H	UVキュア装置 ~4" ウシオ電機 ユニハード UMA-802	ポリイミドキュア炉 ~6" ヤマト科学 DN43H	PE-CVD ~8" 住友精密 MPX-CVD TEOS SiO ₂	スパッタ装置 ~6" アネルバ SPF-730 8インチターゲット×3 Al, AlSi	スパッタ装置 ~8" 芝浦メトロニクス CFS-4E58 3インチターゲット×3 基板加熱1台、基板冷却1台	スパッタ装置 ~8" 芝浦メトロニクス 1 Miller 3インチターゲット×4、基板加熱1台 ロードロック、自動搬送付(10秒まで)
パターンジェネレータ ~6" 日本精工 TZ-310 エマルジョン/マスク作製	レーザー描画装置 ~6" ハイデルベルグワイナウシステム DWL2000CE	スピスコータ ~6" アクテス ASC-4000 2台 ミカサ 1H-DXII 2台	クリーンオーブン ~6" ヤマト科学 DE62 2台	W-CVD 4" アプライマテリアルズ Precision 5000	電子ビーム蒸着装置 ~6" アネルバ EVC-1501	ゾルゲル自動成膜装置 ~4" テクノファイン PZ-804	MOCVD ~8" ウコム研究所 PZT
EB描画装置 ~6" エリオン ELS-G125S Max130keV, 4nm	ステッパ ~6", 6" キヤノン FPA1550M4W gR, 0.65μm	両面アライナ ~6" Suss MA6/BA6 2台	スプレー現像装置 ~6" アクテス ADE-3000S 真空/メカチェック	高温スパッタ 8" ユーテック 21-0604	ALD ~6" テクノファイン ALK-600	ICP-RIE ~4" ULVAC NE-550	CDE ~4" 芝浦メトロニクス CDE-7
酸化・拡散炉 ~6" TEL XL-7 P形用、N形用それぞれ1台	中電流イオン注入装置 ~4" 日新イオン機器 NH-20SR 200keV, 0.8mA	ランプアニール装置 ~4" AG Associates AG4100 1000°C	メタル拡散炉 ~4" 光研リンドバーク Model270 金属、圧電基板等の熱処理	Si Deep-RIE 4台 ~8" 住友精密 MUC-21 SiF ₄ , C ₂ F ₆	ドライエッチング装置 ~6" アネルバ DEA-508 CF ₄ , CHF ₃ (SiN, SiO ₂ 用)	ドライエッチング装置 ~4" アネルバ L-507DL SF ₆ (Si用)	AI RIE 4" 芝浦エレクトロニクス HARRIE-100 Cl ₂ , BCl ₃
アッシング装置 ~6" プラズマ PC4000 13.56MHz, 600W	プラズマクリーナ ~6" ヤマト科学 PDC210	サーフェイスプレーナー ~6" ディスコ DAS8920	ウォーターレーザ ~6" 渋谷工業 LAMICS AQL-1900	多用途RIE ~8" アルバック RH-1515Z Cl ₂ , BCl ₃ , SF ₆ , CF ₄ , CHF ₃ , Ar, O ₂ , N ₂	ECRエッチング装置 3" アネルバ ECR0001 Cl ₂ (GaAs用)	Vapor HF ~6" 住友精密 Primax uEtch	KOH-TMAHエッチング槽 ~6"
ウェハ研磨装置 ~6" BNFテクノロジー Bn52, Bn62	めっき装置 ~6" 山本鍍金試験器 Au, Ni, Cu, Sn	ウェハ接合装置 ~6" Suss SB6e	ダイサ ~6" ディスコDAD522, DAD2H6T 東京精密	イオンミリング装置 ~6" エクス/エス/伯東 20BE-C	ウェハゴミ検査装置 ~6" トプコン WM-3	膜厚測定装置 ~6" Nanometric NanoSpec 3000	段差測定装置 ~6" Dektak8 Tencor AlphaStep 500
ワイヤボンダ 小片 West Bond (おか) Al/Au超音速、Al/Au熱圧着	コンベア炉 ~4" 神鋼精機 FB-260H/TE	レーザーマーカ ~4" GSIエモニクス WM-II	サンドブラスト ~6" 新東工業	深さ測定装置 ~6" ユニオン光学 Hisomet	4探針測定装置 ~6" 小片	拡がり抵抗測定装置 ~6" Solid State Measurements SSM150	赤外線顕微鏡 ~6" オリンパス、浜松ホトニクス
ウェハアライナ 8" EVG Smart View	ウェハ接合装置 ~4" EVG 520	ウェハ間樹脂封入装置 ~4" EVG 520	UVインプリント ~6" 東芝機械 ST50	レーザー/白色光 共焦点顕微鏡(表面形状測定) ~6" レーザテック OPTELCS HYBRID L3-SD	デジタル顕微鏡 ~8" キーエンス クノータクノラフ	電子顕微鏡 ~12" 日立 S3700N 熱電子SEM、EDX付属	電子顕微鏡 小片 日立 S5000 インレンス35FE-SEM
熱インプリント ~50mm角 オリジン電気 Reprina-T50A MAX 650°C, 30kN	TOF-SIMS CAMECATOF-SIMS IV	FIB 小片 SI SM9200	大口径AFM ~8" Digital Instruments Dimension3100	エリプソメトリ ~6" フォニックテック SE-101 ULVAC	マイクロX線CT ~6" コムスキャナテクノ Scanmate D160TS110	超音波顕微鏡 ~12" インサート IS350	直線集束超音波材料解析システム